



边 裁 佑

YEAR OF PRACTICE 2009年 ~ 至今	EDUCATIONAL BACKGROUND 首尔大学 机械工程系 (1999)
ADMISSIONS / AFFILIATIONS - 辨理士 (2009, 第46届) - 大韩辨理士协会 (KPAA)	TECHNICAL EXPERTISE - 半导体设备、半导体制造工艺 - AI, AR/VR, 自动化设备、显示设备、通用机械、汽车零部件、发动机、控制等
CONTACT - Tel: 02-6714-1134 - Email: bjw@nampat.co.kr	PROFESSIONAL EXPERIENCE - 半导体和LCD工艺/仪器领域的国内外专利案件处理 (说明书, 意见书及审判) - 通用机械/汽车配件/发动机领域的专利案件处理 (审判和诉讼) - 测量/控制/半导体制造设备等领域的专利案件处理 (审判和诉讼)